

Preliminary

Otsuka 大塚電子

显微分光膜厚仪

OPTICAL THICKNESS METER

OP series

All Matters, All Solution.

非接触 · 非破坏 · 显微方式
测量时间 1秒!

In a non-contact non-destructive microscopic
from now Measurement time of 1 second !



嵌入式测试头



自动 XY平台

Otsuka Electronics Co., Ltd.

R&D ! QC ! 植入设备 ! 都可简单实现高精度测量 !

For R&D, For QC, For Built in type, we provide the useful system!

测量目标膜的绝对反射率, 实现高精度膜厚和光学常数测试!

(分光干涉法)

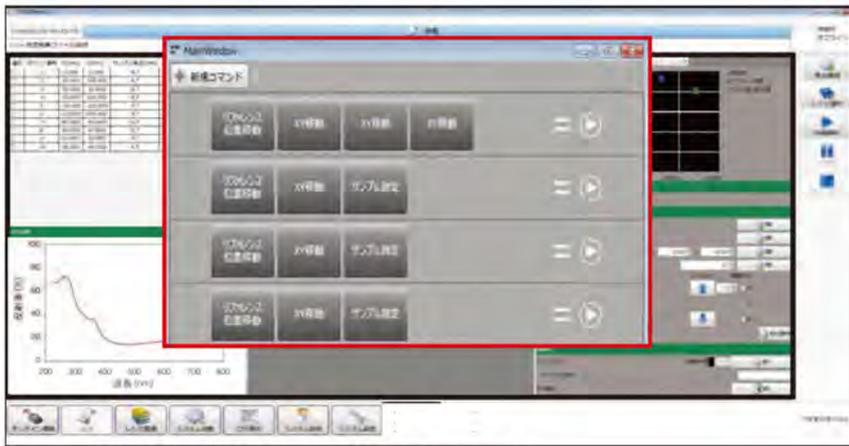
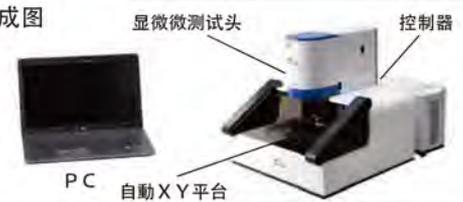
特长 Features

- 膜厚测量中必要的功能集中于头部
- 通过显微分光高精度测量绝对反射率 (多层膜厚、光学常数)
- 1点只需不到1秒的高速tact
- 实现了显微下广测量波长范围的光学系 (紫外~近红外)
- 通过区域传感器控制的安全构造
- 搭载可私人定制测量顺序的强大功能
- 即便是没有经验的人也可轻松解析光学常数
- 各种私人定制对应 (固定平台, 有嵌入式测试头式样)

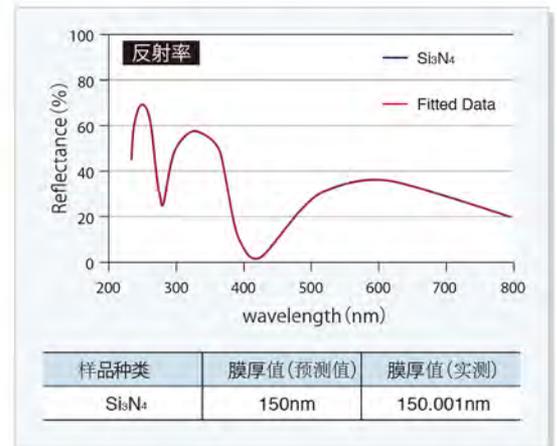
测量项目 Measurement item

- 绝对反射率测量
- 膜厚解析
- 光学常数解析 (n: 折射率、k: 消光系数)

构成图



根据试料的形状和部位, 可轻松定制测量顺序



式样 Specifications

	OP-A1	OP-A2	OP-A3
波长范围 Wavelength Range	230~800nm	360~1100nm	900~1600nm
膜厚范围* Film Thickness Range	1nm~35μm	7nm~49μm	16nm~92μm
样品尺寸 Sample Sizes	Max. 200mm×200mm×17mm		
点径 Spot Sizes	φ 5μm (反射40倍镜头), 改造后可达到3μm		
tact time Measurement Time	1秒/1点		
尺寸 Sizes	本体 (W555×D537×H559mm), 控制单元		(W500×D180×H288mm)
功用 Utilities	750 VA		

- ※ 上述式样是带有自动XY平台。
- ※ release时期是 OP-A1在2016年6月末、OP-A2、OP-A3预定2016年9月。
- * 膜厚范围是SiO₂换算。

- 记载产品的外观式样和软件, 可能由于改良, 在未通知的情况下变更。
- 公司名、商品名等是各个公司的商标, 登陆商标。
- 禁止转载本式样书中的任何内容

大塚電子株式会社

大阪本部・営業部 〒540-0021 大阪府大阪市中央区大手通3丁目1-2
 エスリードビル大手通6F
 TEL.(06)6910-6522 FAX.(06)6910-6528

東京支店 〒192-0082 東京都八王子市東町1-6 橋完LKビル4F
 TEL.(042)644-4951 FAX.(042)644-4961

東北営業所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2丁目2-10 仙都会館5F
 TEL.(022)208-9645 FAX.(022)208-9675

東海営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄3丁目2-3 名古屋日興證券ビル4F
 TEL.(052)269-8477 FAX.(052)269-8478

九州営業所 〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目9-17
 福岡天神フコク生命ビル15F
 TEL.(092)717-3338 FAX.(092)717-3339

<http://www.otsukael.jp/>

16.04.01